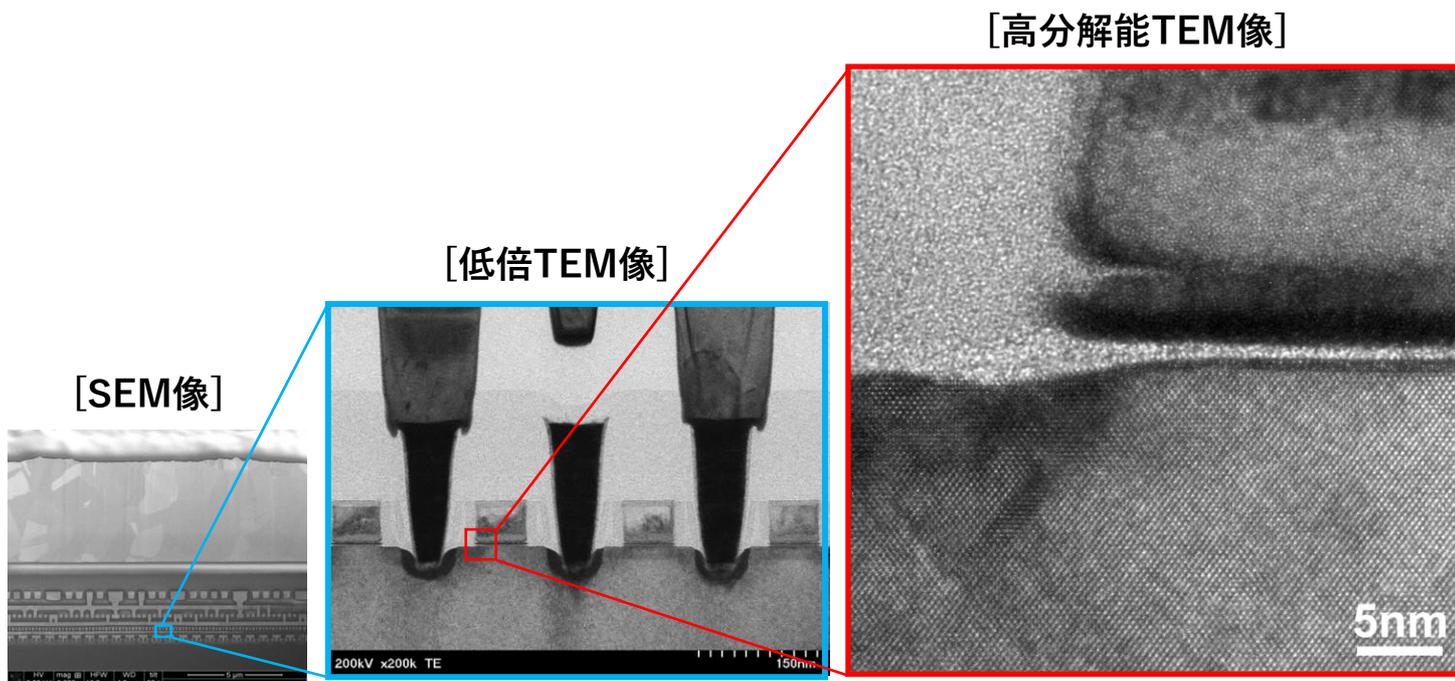


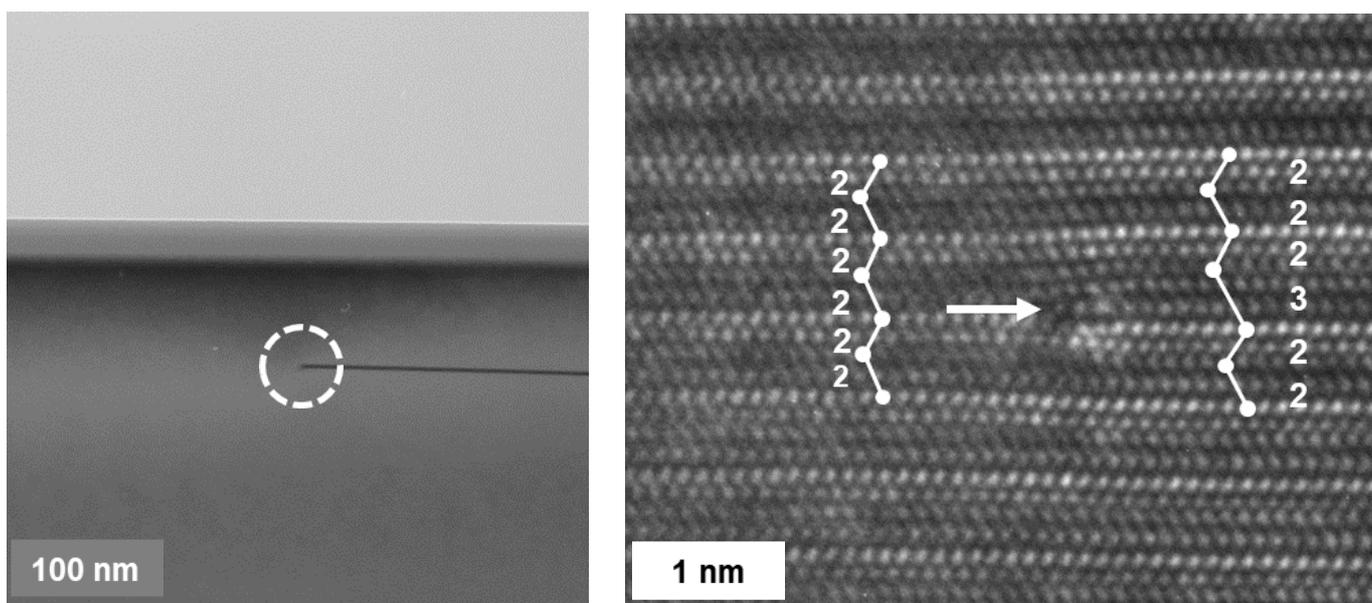
TEMによる構造観察

<特徴>

TEM (透過型電子顕微鏡)は、極微細な構造を高分解能で観察可能な装置です。サブナノオーダーでの構造観察が可能で、薄膜の膜厚評価や半導体結晶基板中の欠陥の観察・構造解析が可能です。



[SiCエピタキシャル層における積層欠陥の回折条件・高分解能での観察と解析]



※引用元：M.Aoki, H.Kawanowa, G Feng, T Kimoto Jpn.J.Appl.Phys.52(2013)061301

お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

<https://iontc.co.jp/contact>

